

2022 年度精密工学会秋季大会公開シンポジウムのご案内

プラナリゼーション CMP とその応用技術専門委員会 200 回記念シンポジウム「“これまで”の振り返りと“これから”の展望」

企画：公益社団法人精密工学会 プラナリゼーション CMP とその応用技術専門委員会

(公社)精密工学会「プラナリゼーション CMP とその応用技術専門委員会」は、CMP とその応用技術を軸に、①産業・研究のグローバル化、②先端半導体デバイスの高集積化、③応用分野の多様化、④加工技術のサイエンス化、⑤人材の育成、の5つの観点から、技術、学術、並びに産業の発展に寄与することを目的としている。1994 年に前身である産学共同研究協議会が発足以来、着実に歩みを進め、このたび 200 回目となる研究会を迎える。この 200 回記念シンポジウムでは CMP 技術の進歩と CMP が半導体デバイスの発展に果たした“これまで”の役割を振り返るとともに、“これから”を展望し、本委員会を運営する幹事団をファシリテーターとして議論する場としたい。

開催日時 2022 年 9 月 7 日(水) 14 時 15 分～17 時 20 分

会 場 オンサイト(プラザエフ)および Zoom によるハイブリッド開催

参加費 無 料

* オンサイトへの参加は感染拡大防止の観点から参加可能人数を制限するとともに、事前予約制とします。詳しくは、プラナリゼーション CMP とその応用技術専門委員会のホームページをご覧ください。

プラナリゼーション CMP とその応用技術専門委員会

<https://www.planarization-cmp.org/>

* 完全オンラインに切り替える可能性もあります。完全オンラインに切り替える場合、同委員会事務局よりオンサイト参加登録者へ変更案内をいたします。

* Zoom で参加希望の方は事前予約は不要です。オンライン講演室への参加方法は 8 月 25 日以降に秋季大会ウェブサイトでお知らせいたします。

プログラム

司 会：幹事 金沢工業大学 畷田 道雄

時間	講演題目・講師
14:15～14:25 (10分)	オープニングリマーク 委員長 株式会社荏原製作所 檜山 浩國
14:25～14:45 (20分)	本委員会設立の背景と歩み 名誉会長 九州大学/埼玉大学名誉教授 株式会社 Doi Laboratory 土肥 俊郎
14:45～15:10 (25分)	CMP 装置化技術の開発と社会実装までの歩み 特別顧問 株式会社荏原製作所 辻村 学

15:10~15:40 (30分)	1990年代におけるCMPプロセス立上げの苦労話 副委員長 昭和電工マテリアルズ株式会社 近藤 誠一
15:40~15:55 (15分)	休憩
15:55~16:30 (35分)	【Invited Speech】 Approaches to Sustainability in Chemical Mechanical Polishing (CMP): A Review アドバイザー Pusan National Univ. Hae-do Jeong
16:30~16:50 (20分)	国際会議の創設とそのキーワード(PacRim から ICPT へ) 会計監事 キノシタ・コンサルティング 木下 正治
16:50~17:10 (20分)	CMP サマーキャンプの創設とそれを通じた人材育成の取り組み 幹事 ウェスタンデジタル合同会社 山田 洋平
17:10~17:20 (10分)	クロージングリマーク 副委員長 九州大学 黒河 周平

※※プログラムは変更となる場合がございます。何卒ご了承のほどお願い申し上げます。